

動作確認チェックシート

検査日	2025年10月3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	微小線幅測定装置	電源電圧	1φ 100V/15A	XY電動ステージ 駆動スケール	ACサーボモータ μm単位) (1
型式	WF-R55UV-H5	周波数	50/60Hz		リニアスケール (0.1μm単位)
メーカー名	(株)日立国際電気	ワークサイズ ワーク高さ	4inc,5inc,6inc	位置決め精度	±3μm
機械Ser.No	A013973		525~625μm	ステージ部ストローク	150mm
製造年月	2006年11月	ユーティリティ	Air:5.9x10 ⁻³ Pa VAC:35kPa	寸法	(W)1730x(D)1000x(H)1680mm

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) ロボット BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

装置概要

・光学顕微鏡及びCCTVカメラ装置、XY電動ステージを組み合わせた微小寸法物の線幅を非接触で比較測定する装置

- 1.装置起動⇒起動時、一連の動作インチャライズ及び異常音・・・問題なし。
- 2.マニュアルX-Yステージ及びロボット動作確認・・・問題なし。
- 3.Sample測定確認・・・問題なし。別紙参照

2019年10月2日初回動作確認日 作業時間：10hr

(測定は全て手動計測によるもの)

OS:WindowsXP

【測定部 視野(カメラCCD:1/3 型)】

対物レンズ	モニタ視野(X×Y)μm(±10%)	用途	接眼レンズ
150, (UV) 150/0.90UV/0.95mm	22×20	測定用	HC PLAN10×/25
100, HCX PL FLUOTAR100 x/0.90 BD	32×30	測定用	
50, HCX PL FLUOTAR50x x/0.90 BD	64×60	測定用	
20, HCX PL FLUOTAR20x x/0.50 BD	160×150	測定用	
5, HCX PL FLUOTAR5x x/0.15 BD	620×580	位置認識用	

※取扱より抜粋:本装置は比較測定機ですので、既知の
試料で寸法比較してから測定して下さい。

【基準Sample測定(手動計測)】



【測定終了後ロボット搬送チェック(Wafer Un Load)】



【ロボット搬送チェック(Wafer Load)及び測定】

(※Wafer Size φ6")



取扱説明書:有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
前回確認日2019年10月2日	動作確認⇒問題なし。(但し、測定は全て手動計測にて確認)	雨宮

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK

作業工数 [3.5 hr]

検査担当者[雨宮]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

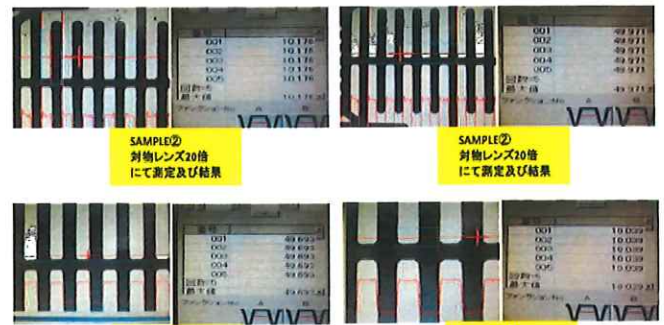




SAMPLE①
対物レンズ20倍
にて測定及び結果

SAMPLE①
対物レンズ50倍
にて測定及び結果

SAMPLE②
対物レンズ5倍画像
(参考)



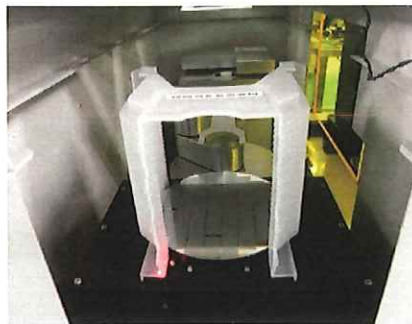
SAMPLE②
対物レンズ20倍
にて測定及び結果

SAMPLE②
対物レンズ20倍
にて測定及び結果

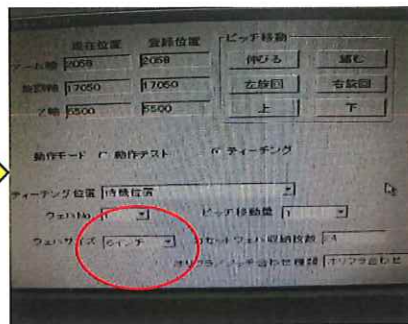
SAMPLE②
対物レンズ50倍
にて測定及び結果

SAMPLE②
対物レンズ100倍
にて測定及び結果

2025年10月3日 再動作確認



6inc Wafer Set



6inc Wafer 選択



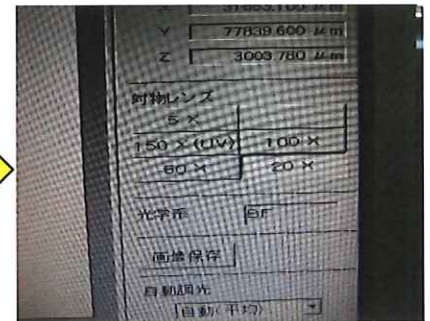
手動計測選択



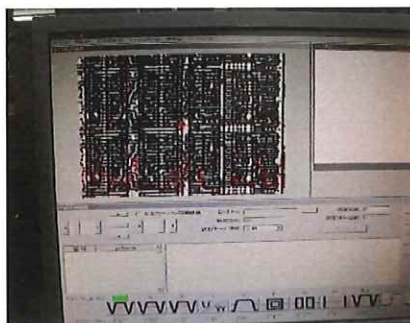
アライメントステージへ搬送



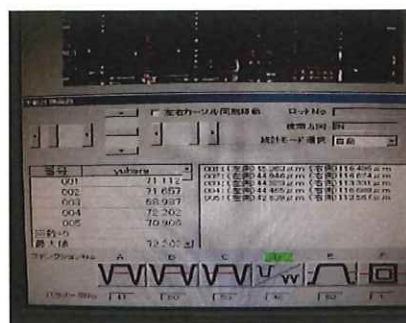
ウェハステージへ搬送



対物レンズ20xに変更



線幅測定



線幅測定結果

以上を以て再動作確認⇒問題なし。